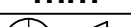


2026年6月22日 16:45:30			一般公差	倒 角	未注倒角处均已C0.3倒角之			图 号	波片系统_波片座_v 1
				>100 ±0.1 >10 ±0.02					
说 明	修改者	日 期		>50 ±0.05	>0 ±0.003			机构名称	
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例		制 图	设 计	材 质	6061	数 量	机 型 名 称	
	单 位	mm			表面处理	喷砂本色氧化	3		
	角 法		2026年6月22日		热处理				